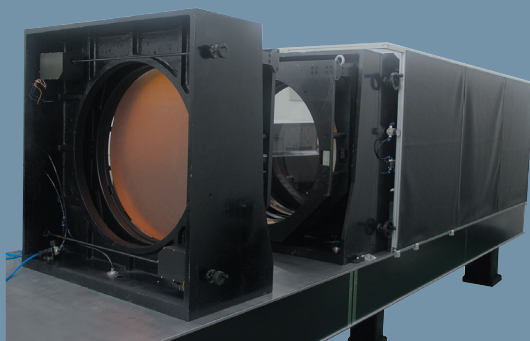


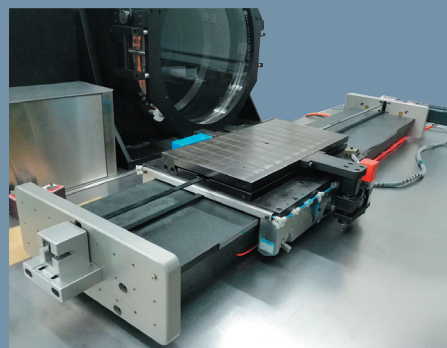
# 600 mm激光干涉仪（含拼接装置）

Φ600 mm Laser Interferometer (Including Sticking Device)

IFM600-WT(S)



Φ600 mm 激光干涉仪——拼接装置



Φ600 mm 激光干涉仪

## 主要技术与性能指标

- 测量口径：Φ600 mm（可定制到 Φ800 mm）
- 标准参考镜面形精度（PV）：优于  $0.1\lambda$
- 重复性 RMS：优于 0.6 nm
- 系统传递函数：(ITF)  $> 0.7@0.4 \text{ cycles/mm}$
- 拼接测量口径：1 400 mm × 420 mm
- 拼接测量精度（PV）：优于  $0.1\lambda$

## 主要应用

强激光装置、天文光学、空间光学等领域大口径光学元件检测

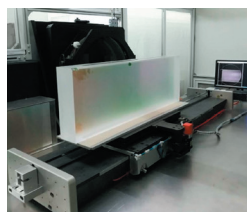
## 代表性应用成果

发明专利

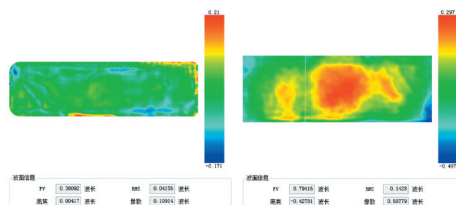
- 刘世杰，周游，白云波，等．大口径高平行度光学元件波前检测装置：中国，

ZL 201610024221.1. 2018-12-25.

- 刘世杰，周游，白云波，等．双通道双波长干涉检测装置：中国，ZL 201610551583.6. 2019-06-18.
- 刘世杰，白云波，周游，等．平面光学元件绝对面形检测装置：中国，ZL 201710380378.2. 2019-05-17.



米级光栅基板拼接测量



米级光栅基板反射面形误差及米级光栅衍射波前测量结果

主要用户单位	中国科学院上海光学精密机械研究所、上海恒益光学精密机械有限公司、中国建筑材料科学研究总院、中国工程物理研究院八所、苏州大学、中国科学技术大学、上海理工大学等
研制单位	中国科学院上海光学精密机械研究所
联系方式	刘世杰 021-59962310, 13701930842 shijeliu@siom.ac.cn